

The Design and Implementation of SECS- Communication Human-Machine Interface for Semiconductor Manufacturing Automatio

林志傑、周鵬程

E-mail: 9315034@mail.dyu.edu.tw

ABSTRACT

ABSTRACT In the sharp competitive semiconductor industry, utilizing automatic manufacturing equipment to upgrade quantity and quality has been the consensus in the industry for years. There is no way to plan a complete and integrated automatic process system because of the automatic problem of the machine itself or the communication interface problem among various machines. So Semiconductor Equipment And Material International (SEMI) promulgated Semiconductor Equipment Communication Standard (SECS), in early 1980, this particular standard specifies the interface signals between semiconductor manufacturing equipment, master monitoring controllers and the content of communication information in order to promote automation of semiconductor manufacturing. This study is to develop an interface program to meet the SEMI standard. The second human-machine interface programs are written in VB6.0 language. Another purpose of this study is to introduce the WinSecs interface and it's communication with the SECS Interface.

Keywords : SECS ; SEMI ; VB

Table of Contents

授權書	iii 中文摘要
vi 英文摘要	v 致謝
vi 目錄	vii 圖目錄
ix 表目錄	xii 第一章 緒論 1.1簡介
1.2研究動機	
1.3內容摘要	3 第二章 SECS- 通訊協定之簡介 2.1 SECS- 簡介
2.2 SECS- 資料結構	6 2.3 SECS物件結構
8 第三章 簡介HSMS 標準 3.1簡介HSMS	
10 3.2 HSMS的連線狀態圖	10 3.3 HSMS訊息交握程序
12 3.4 HSMS訊息格式	13 第四章 ISECS介面程式的規劃與實現 4.1架構與說明
17 4.3 ISECS程式介面實現	16 4.2 ISECS程式介面規劃
19 第五章 ISECS介面程式測試並與WinSecs連線測試結果 5.1 ISECS介面程式測試	17 4.3.1介面功能說明
43 5.1.1 ISECS介面程式參數設定	43 5.1.2 ISECS介面程式連線
45 5.2 ISECS與WinSecs 連線測試	47 5.2.1 WinSecs簡介
47 5.2.2 WinSecs參數設定	47 5.2.3 ISECS與WinSECS 連線測試
49 第六章 結論	53 附錄
54 參考文獻	
58 圖目錄 圖1.1自動化架構圖	2 圖2.1 Stream及Function配置圖
5 圖2.2 SECS- 定義的Stream和Function	5 圖2.3 Item和List 的Header
7 圖2.4 Secs 結構圖	9 圖3.1 HSMS狀態圖
12 圖4.1架構圖	16 圖4.2引用元件庫
19 圖4.3 Main主表單畫面	20 圖4.4新增New Transaction
21 圖4.5刪除Transaction及其子代	22 圖4.6正在編輯之Library
23 圖4.7初始畫面	23 圖4.8開啟指定*.SML檔
24 圖4.9產生資料樹	24 圖4.10正在編輯之Library
25 圖4.11顯示上述畫面供使用者設定檔案名稱與位置	25 圖4.12開啟通訊埠
26 圖4.13關閉通訊埠	27 圖4.14 Send Message
28 圖4.15 General 標籤頁面	28 圖4.16 HSMS 標籤頁面
31 圖4.17 SECSEdit表單畫面	

.....	31 圖4.18未AddChild前	33 圖4.19 AddChild後
.....	33 圖4.20未New Transaction 前	34 圖4.21 New Transaction
後	34 圖4.22未Duplicate 前	35 圖4.23 Duplicate後
.....	36 圖4.24未DELETE前	37 圖4.25
DELETE後	37 圖4.26 未Insert Sibling前	38
圖4.27 Insert Sibling 後	38 圖4.28複製節點內資料	
.. 40 圖4.29貼到S1F2之子代	40 圖4.30拖拉資料	
.. 41 圖4.31拖拉至S1F2之子代	41 圖4.32 SECSEdit檔案功能表	
..... 42 圖5.1讀取共同的SML檔	44 圖5.2HSMS參數設定	
..... 44 圖5.3 ISECS相互連線	45 圖5.4由主動端傳	
送S1F3到被動端是否確定傳送	45 圖5.5確定主動端傳送與被動端接收S1F3	45 圖5.6由被
動端傳送S1F5到主動端	46 圖5.7確定由被動端傳送與主動端接收S1F5	46
圖5.8由主動端進行連線中斷	46 圖5.9 WinSECS讀取共同SML檔	
.. 48 圖5.10 WinSECS之HSMS設定	48 圖5.11將兩端Open埠開啟	
..... 49 圖5.12兩端連線成功	50 圖5.13傳送S1F1 Transaction	
..... 51 圖5.14 WinSECS傳送S1F7之Transaction	51 圖5.15中斷連線	
..... 52 表目錄 表2.1 SECS- 定義之Format Code	7 表3.1 HSMS訊	
信息格式	13 表3.2 HSMS訊息標頭	14
表3.3 HSMS訊息格式綜整	15	

REFERENCES

參考文獻 [1]SEMI E5-0301 : SEMI EQUIPMENT COMMUNICATION STARDAND 2 MESSAGE TRANSFER(SECS-II) [2]SEMI E37-0298 : HIGH-SPEED SECS MESSAGE SERVICES(HSMS) [3]VISUAL Basic6.0入門、實務與資料庫 王國榮 著 [4]劉志鵬 半導體製程設備之通訊模組(一)SecsItem物件，中山科學研究院第二研究所飛行控制組，90年 [5]劉志鵬 半導體製程設備之通訊模組(二)SecsMessage物件，中山科學研究院第二研究所飛行控制組，90年 [6]劉志鵬 半導體製程設備之通訊模組(三)SecsTransaction物件，中山科學研究院第二研究所飛行控制組，90年 [8]林國棟，PLC控制機台之半導體設備標準通信協定模組設計,中華大學機械與航太工程研究所碩士論文,2000 [9]謝寶松，“半導體製程自動化中GEM/SECS通訊界面及儀器伺服器之 設計與實現 ”,國立台灣工業技術學院電機工程研究所碩士論文,1995 [10]葉整樹，“半導體製程設備電腦標準通訊自動化系統設計 ”,中華工學院航空太空工程研究所碩士論文，1997 [11]李瑞琳，簡介半導體業界使用的設備通訊規格(SECS/GEM)，機械工業雜誌，89年4月 [12]工研院設備控制部副研究員李文猶,半導體廠自動化之通訊協定SECS I/II & GEM ,2000